



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 105651542 B

(45)授权公告日 2020.04.17

(21)申请号 201511022326.5

(22)申请日 2015.12.29

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 105651542 A

(43)申请公布日 2016.06.08

(73)专利权人 芜湖东旭光电科技有限公司
地址 241000 安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道纬二次路36号
专利权人 东旭光电科技股份有限公司

(72)发明人 林海峰 李兆廷 石志强 李震
李俊生

(74)专利代理机构 北京英创嘉友知识产权代理
事务所(普通合伙) 11447
代理人 桑传标 陈庆超

(51)Int.Cl.

G01N 1/04(2006.01)

(56)对比文件

CN 103698907 A,2014.04.02,
CN 204752694 U,2015.11.11,
JP 特开2000-321180 A,2000.11.24,
CN 203148712 U,2013.08.21,
CN 1566919 A,2005.01.19,

审查员 朱醒醒

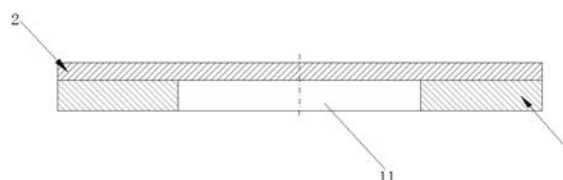
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

玻璃基板取样装置和方法

(57)摘要

本发明公开了一种玻璃基板取样装置和玻璃基板取样方法,所述玻璃基板取样装置包括带有取样孔(11)的取样块(1),以及固定在该取样块(1)的一侧并覆盖所述取样孔(11)的盖板(2),所述取样块(1)的另一侧用于固定到玻璃基板缺陷表面上,且玻璃基板表面缺陷保持在所述取样孔(11)内。这样,使得玻璃基板样品不会被污染,提升光谱仪理化分析结果的准确性。



1. 一种玻璃基板取样装置,其特征在于,该取样装置包括带有取样孔(11)的取样块(1),以及固定在该取样块(1)的一侧并覆盖所述取样孔(11)的盖板(2),所述取样块(1)的另一侧用于固定到玻璃基板缺陷表面上,且玻璃基板表面缺陷保持在所述取样孔(11)内,所述盖板(2)为玻璃。

2. 根据权利要求1所述的玻璃基板取样装置,其特征在于,所述取样块(1)由PVC、不锈钢、铝型材或聚醚醚酮制得。

3. 根据权利要求1所述的玻璃基板取样装置,其特征在于,所述取样块(1)的一侧设置有第一双面胶布以固定于所述盖板(2)。

4. 根据权利要求1或3所述的玻璃基板取样装置,其特征在于,所述取样块(1)的另一侧设置有第二双面胶布以固定于所述玻璃基板缺陷表面。

5. 一种玻璃基板取样方法,其特征在于,该取样方法包括使用缺陷检查设备查找玻璃基板缺陷表面,并通过量具确定玻璃基板表面缺陷的位置坐标,然后将权利要求1-4中任意一项所述的玻璃基板取样装置固定到所述玻璃基板缺陷表面,使所述玻璃基板表面缺陷保持在所述取样孔(11)内。

6. 根据权利要求5所述的玻璃基板取样方法,其特征在于,在所述玻璃基板取样装置固定到所述玻璃基板缺陷表面之后,通过使用玻璃割刀沿着所述玻璃基板取样装置的外轮廓将样品从整块玻璃基板上割下。

7. 根据权利要求5所述的玻璃基板取样方法,其特征在于,使用卤素灯或强光手电来查找玻璃基板缺陷表面。

玻璃基板取样装置和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及玻璃基板生产领域,具体地,涉及一种玻璃基板取样装置和玻璃基板取样方法。

背景技术

[0002] 在玻璃基板检查工序中,对玻璃基板表面异物进行取样后,需要通过光谱仪对其理化分析成分。现有技术中,通过将表面具有异物的玻璃基板样本,从整块的玻璃基板上割取,并收纳于取样袋中送到实验室进行成分分析。但在实践中,会受到多种因素影响而造成理化分析结果不准确,例如割断玻璃基板产生的颗粒粉尘会粘附到玻璃基板样本上,玻璃基板样本与取样袋摩擦会将异物划掉,玻璃基板样本上可能粘附其他异物,等等。

发明内容

[0003] 本发明的一个目的是提供一种玻璃基板取样装置,该取样装置能够避免玻璃基板样品被污染,提升光谱仪理化分析结果的准确性。

[0004] 本发明的另一个目的是提供一种玻璃基板取样方法,该取样方法简单易行,能够准确取样。

[0005] 为了实现上述目的,本发明的一个方面,提供一种玻璃基板取样装置,该取样装置包括带有取样孔的取样块,以及固定在该取样块的一侧并覆盖所述取样孔的盖板,所述取样块的另一侧用于固定到玻璃基板缺陷表面上,且玻璃基板表面缺陷保持在所述取样孔内。

[0006] 优选地,所述盖板为玻璃,所述取样块由PVC、不锈钢、铝型材或聚醚醚酮制得。

[0007] 优选地,所述取样块的一侧设置有第一双面胶布以固定于所述盖板。

[0008] 优选地,所述取样块的另一侧设置有第二双面胶布以固定于所述玻璃基板缺陷表面。

[0009] 根据本发明的另一方面,提供一种玻璃基板取样方法,该取样方法包括使用缺陷检查设备查找玻璃基板缺陷表面,并通过量具确定玻璃基板表面缺陷的位置坐标,然后将根据本发明提供的玻璃基板取样装置固定到所述玻璃基板缺陷表面,使所述玻璃基板表面缺陷保持在所述取样孔内。

[0010] 优选地,在所述玻璃基板取样装置固定到所述玻璃基板缺陷表面之后,通过使用玻璃割刀沿着所述玻璃基板取样装置的外轮廓将样品从整块玻璃基板上割下。

[0011] 优选地,使用卤素灯或强光手电来查找玻璃基板缺陷表面。

[0012] 本发明的有益效果是:通过玻璃基板取样装置对具有表面缺陷的玻璃基板进行取样,使得玻璃基板样品不会被污染,提升光谱仪理化分析结果的准确性。

[0013] 本发明的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

[0029] 以上结合附图详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。

[0030] 另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。

[0031] 此外,本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明的思想,其同样应当视为本发明所公开的内容。

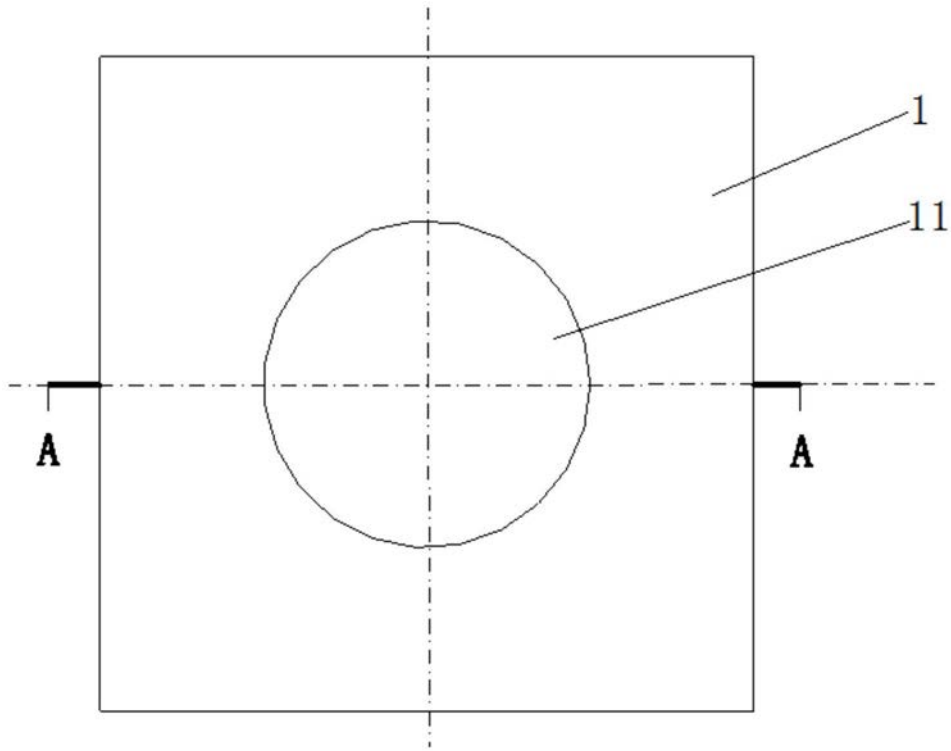


图1

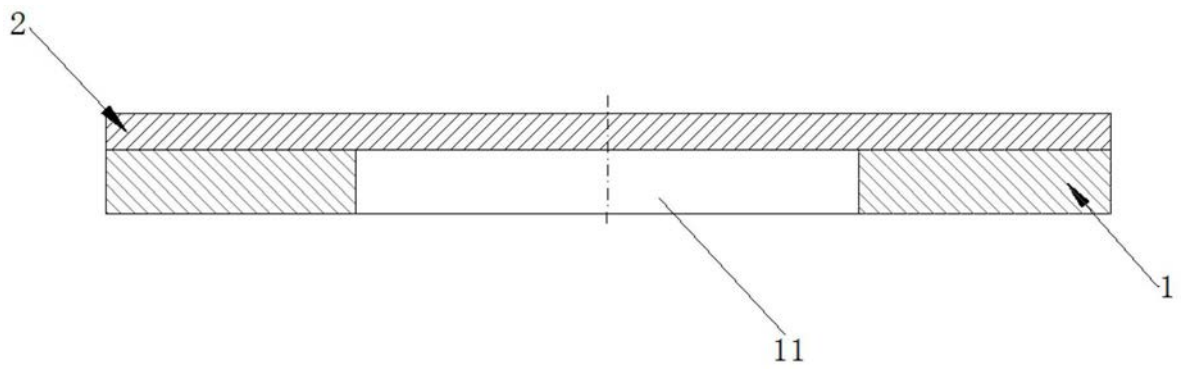


图2